BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-074823

(43) Date of publication of application: 18.03.1994

(51)Int.CI.

G01J 3/18 G01N 21/27

(21)Application number: 04-228128

(71)Applicant : KUBOTA CORP

(22)Date of filing:

27.08.1992

(72)Inventor: ISHIBASHI HITOSHI

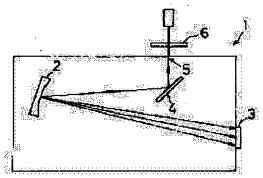
SHICHIRI MASATAKA

UENAKA SUSUMU TATSUMI YASUO

(54) WAVE LENGTH CALIBRATION METHOD FOR SPECTROSCOPIC ANALYZER

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a wave length calibration method for spectroscopic analyzer capable of working efficiently and easily in calibrating accompanied by on-site adjustment of the spectroscopic analyzer. CONSTITUTION: This wave length calibration method for a spectroscopic analyzer searches the correspondence between the element number at adjustment object unit and the wave length of received light in accordance with a standard unit with known correspondence between the element number of a plurality of elements provided to an dumb bell shape light receiving element 3 and the wave length of the received light. A filter for calibration 6 is prepared to obtain light beam for calibration having two peaks in measured wave length range by letting white light pass. The light beam for calibration is introduced in the standard unit and wave lengths at two peaks are obtained. Also, the light beam for calibration is introduced in the adjustment object unit



to detect the element number for detecting the peak spectrum and obtain the correspondence between the element number in the adjustment object unit and the wave length.

DEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-74823

(43)公開日 平成6年(1994)3月18日

(51) Int. C1.5

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 J 3/18

9215 - 2 G

G 0 1 N 21/27

F 7370 - 2 J

審査請求 未請求 請求項の数1

(全4頁)

(21)出願番号

特願平4-228128

(22)出願日

平成4年(1992)8月27日

(71)出願人 000001052

株式会社クポタ

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目2番47号

(72)発明者 石橋 仁志

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社ク

ボタ技術開発研究所内

(72)発明者 七里 雅隆

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社ク

ボタ技術開発研究所内

(72)発明者 上中 進

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社ク

ボタ技術開発研究所内

(74)代理人 弁理士 北村 修

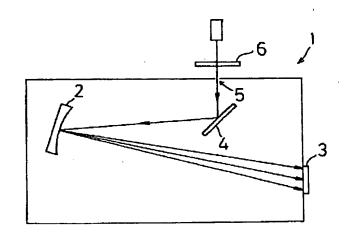
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】分光分析計の波長校正方法

(57)【要約】

【目的】 分光分析計の現場での調整に伴う校正作業に あたっても、作業を能率的におこなうことが可能である とともに、作業が容易な分光分析計の波長校正方法を得 る。

【構成】 アレイ型受光素子3に備えられる複数の素子の素子番号と受光光の波長との対応が既知である標準ユニットに対応させて調整対象のユニットに於ける素子番号と受光光の波長との対応を求める分光分析計の波長校正方法であって、測定波長範囲内において2つのピーク部を備える校正用光線束を、白色光を透過させることによって得られる校正用フィルター6を用意し、校正用光線束を標準ユニットに入射させて、2つのピーク部の波長を求め、この校正用光線束を調整対象のユニットに入射させてスペクトルのピークを検出する素子番号を検出して、調整対象のユニット内の素子番号と波長との対応を求める。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 分光対象の光線束が入射される凹面回折 格子(2)と、前記凹面回折格子(2)より回折する回 折光を受光するアレイ型受光索子(3)とを備えた分光 分析計(1)に対し、前記アレイ型受光素子(3)に備 えられる複数の素子の素子番号と受光光の波長との対応 が既知である標準ユニットに対応させて、調整対象のユ ニットに於ける索子番号と受光光の波長との対応を求め る分光分析計の波長校正方法であって、

白色光を透過させることによって測定波長範囲内におい 10 て2つのピーク部を備える校正用光線束を、得られる校 正用フィルター(6)を用意し、前記校正用光線束を前 記標準ユニットに入射させて、前記2つのピーク部の波 長を求める準備工程と、

前記校正用光線束を前記調整対象のユニットに入光さ 世、

前記調整対象のユニットに於ける前記アレイ型受光索子 の素子番号と波長との対応関係を、前記準備工程で得ら れる2つのピーク部の波長と前記2つのピーク部の波長 の光を受光する前記調整対象ユニットに備えられるアレ イ型受光素子の2つの素子番号とから求める校正工程と から構成される分光分析計の波長校正方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、分光対象の光線束が入 射される凹面回折格子と、凹面回折格子より回折する回 折光を受光するアレイ型受光素子とを備えた分光分析計 に対して、アレイ型受光索子に備えられる複数の索子の 素子番号と受光光の波長との対応が既知である標準ユニ ットに対応させて、調整対象のユニットに於ける素子番 号と受光光の波長との対応を求める分光分析計の波長校 正方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般的な分光分析計は図1に示すような 構成になっており、アレイ型受光索子に入射される光の 波長は、各光学部品の特性と、各部品間の位置関係によ って定まる。ここで、このアレイ型受光素子は数 1 0 μ m幅の受光素子がアレイ状に並んでいるもので、凹面の 回折格子によって分光された光が、各波長毎に一個一個 の素子に焦点を結ぶよう設計され、且つ組み立て時に、 各部品間の位置調整を必要とする。ここで、各索子にど の波長の光が入射しているかを知るには、波長が既知で 急峻なピークを有するスペクトルの光(例えばレーザー 光)を分析計に入射させ、そのピークが現れる索子番号 を用いて、素子番号と波長を対応づけていた。一方、複 数台製作の際は、各光学部品の位置を調整して、できる だけ同じになるように合わせているが、10μmオーダ の調整であり、完全に一致させるのは困難である。従っ て、複数台の分光分析計においては、個々に索子番号と あるとともに、従来、この種の分光分析計のアレイ型受

光索子の索子番号と受光光の波長との対応を求める場合 には、上述のレーザー光を使用する方法を、機台個々に おこなう必要があった。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな方法を採用する場合は、レーザー光の照射装置、制 御装置を備える必要があるため、調整に手間が掛かっ た。また、レーザー光を使用する場合は、組み付け誤差 によりデータ差が大きく、素子内でのピークの判定が難 しかった。さらに、分光分析計を使用している現場(製 造工場以外の所)での調整には、この手法を用いるに は、レーザー光照射装置を、一々、持参する必要があ り、非常に作業能率が悪かった。従って、本発明の目的 は、分光分析計の現場での調整に伴う校正作業にあたっ ても、作業を能率的にかつ確実におこなうことが可能で あるとともに、作業が容易な分光分析計の波長校正方法 を得ることである。

[0004]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するため の本発明による分光分析計の波長校正方法の特徴手段 は、白色光を透過させることによって測定波長範囲内に おいて2つのピーク部を備える校正用光線束を、得られ る校正用フィルターを用意し、校正用光線束を標準ユニ ットに入射させて、2つのピーク部の波長を求める準備 工程と、校正用光線束を調整対象のユニットに入光さ せ、調整対象のユニットに於けるアレイ型受光素子の素 子番号と波長との対応関係を、準備工程で得られる2つ のピーク部の波長と2つのピーク部の波長の光を受光す る調整対象ユニットに備えられるアレイ型受光素子の2 つの索子番号とから求める校正工程とから構成されるこ とにあり、その作用・効果は次の通りである。

[0005]

【作用】つまり、準備工程においては、予め索子番号と 波長との対応が取れている標準ユニットに、校正用フィ ルターを透過した白色光を入射させて、透過光に存する 2つのピークの波長が特定される。そして、分光分析計 の製造現場あるいは調整作業(各機器間の位置、姿勢調 整等)をおこなう現場においては、調整対象の分光分析 計に対して、光源として白色光源を使用し、前記の校正 用フィルターにこの白色光線を透過させて、透過光を分 光分析計に入光させて分光分析計における索子番号と受 光する光の波長との対応をとる。ここで、入射する光の 波長とこれらの波長を受ける素子番号が既知となるた め、調整対象のユニットにおける素子番号と波長の対応 が容易にとれる。この作業をおこなう場合は、2つの波 長を個別にあるいは同時に発信するレーザー光源等を用 意する必要はなく、標準ユニットと調整対象のユニット とにおいては、共に同一型式の機器(凹面回折格子、ア これらの素子に受光される光の波長を求めておく必要が 50 レイ型受光素子等)が装備されるため、このピークの検

出状況(各素子に渡るビークの出現状況)は、調整対象 の分光分析計においても、よく標準ユニットの状態を代 表して再現される。従って、判別が容易となる。

[0006]

【発明の効果】結果、同一仕様の分光分析計(ポリクロ メータ)を複数台製作する際、或いは、調整後のユニッ トと標準ユニットとの対応をとる場合に、素子番号と波 長の対応づけを簡便、且つ簡単に行える。この方法で は、基準となる1台(標準ユニット)だけレーザ等を使 って素子番号と波長の関係を求めて、波長校正用フィル 10 ける素子番号と波長との対応を取るものである。以下、 ターのスペクトルのみ保存しておけば、2台目(調整対 象のユニット) 以降はレーザーによる波長校正が不用と なり、例えば客先での修理校正等が簡単に行える。従っ て、ユニットのコピーが造り易い。

[0007]

【実施例】以下本願の実施例を図面に基づいて説明す る。図1には、分光分析計1の構成が示されている。分 光分析計1は、凹面回析格子2とアレイ型受光素子3と 平面鏡4とを備えて構成されており、スリット5より入* *射される分光対象の光線束が、平面鏡4により反射され て、凹面回析格子2に導かれ、この格子2により回折す る回折光が前述のアレイ型受光素子3に受光される。こ のアレイ型受光素子2上においては、光線は分光され る。

【0008】さて、以下に本願の分光分析計1の波長校 正方法について説明する。ここで、波長校正とは、予め 素子番号と各素子に受光される光の波長の関係が判明し ている標準ユニットに合わせて、調整対象ユニットにお 手順を箇条書きする。

1) 標準ユニットに関しては、従来通りレーザー光によ って波長と素子番号の関係を求めておく(この工程は従 来からおこなわれているものと同一である)。 素子番号 iとこれらの素子に受光される光の波長は、以下のよう になる。

[0009]

【数1】

$$\lambda_A(i) = \lambda_1 + (\lambda_2 - \lambda_1) \times \frac{(i-i_1)}{(i_2-i_1)}$$

表子番号 i 番目の素子が受ける光の波長(標準ユニット) λ_A(i)

二つのレーザー光の波長 λ_1 λ_2

任意の素子番号

二つのレーザー光を受ける素子の素子番号

【0010】2) 白色光透過により、測定波長範囲内 で、急峻なピークを2つ以上有する校正用フィルター6 を用いて標準ユニットでスペクトルを測定する。このよ うな校正用フィルター透過光のピーク波長の確認工程 を、準備工程と呼ぶ。ピークの表れる素子番号を & 1, a2とする。

3)数1より、校正用フィルターの透過光においてピー クとなる波長は、標準ユニットの素子番号α1で置き換 えられ: 入11=入A(a1)、素子番号a2の波長入22= 入A (A₂) とあらわされる。ここで、標準ユニットに対 する処理は、校正用フィルターの透過光のピーク波長の 40 確認にあるため、一度やっておけばよい。

- 30※4) 前述の校正用フィルターを透過した光(校正用光線 束と呼ぶ)を用いて調整対象のユニットでスペクトルを 測定する。そのピークの表れる索子番号をb1, b2と表 す。
 - 5)標準ユニットと調整対象のユニットで得られるスペ クトルの、2つのピークの波長は同一であるので、調整 対象のユニットでは素子番号り」のとき入い、素子番号 b₂のときん₂₂である。よって、調整対象のユニットで の素子番号と波長の関係は数2で表される。

[0011]

【数2】

$$\lambda_{B}(i) = \lambda_{11} + (\lambda_{22} - \lambda_{11}) \times \frac{(i-b_{1})}{(b_{2}-b_{1})}$$

λg(i) 素子番号i番目の素子が受ける光の波長(調整対象ユニット)

【0012】ここで、4)、5) に示す工程を校正工程 と呼ぶ。また、調整対象のユニットに対する処置は、調 整毎におこなう必要がある。

【0013】さて、分光分析計の製造現場あるいは調整 50 一とを使用しておこなえば、この分光分析計における素

作業(各機器間の位置、姿勢調整等)をおこなう現場に おいては、上述の第4、第5工程のみを、対象の分光分 析計に対して、光源としての白色光源と校正用フィルタ

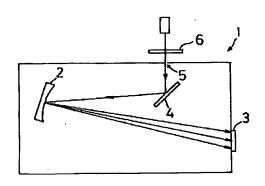
5

子番号を受光する光の波長との対応が取れる。従って、この作業をおこなうのに、2つの波長を個別にあるいは同時に発信するレーザー光源等を用意する必要はない。 【0014】尚、特許請求の範囲の項に図面との対照を便利にするために符号を記すが、該記入により本発明は添付図面の構成に限定されるものではない。

【図面の簡単な説明】

【図1】分光分析計の構成を示す図

【図1】

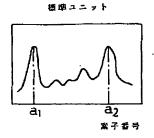


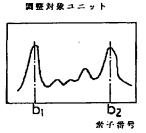
【図2】標準ユニットと調整対象のユニットにおける素 子番号とスペクトルとの関係を示す図

【符号の説明】

- 1 分光分析計
- 2 凹面回折格子
- 3 アレイ型受光素子
- 6 校正用フィルター

【図2】





フロントページの続き

(72)発明者 辰己 保夫

兵庫県尼崎市浜1丁目1番1号 株式会社 クボタ技術開発研究所内